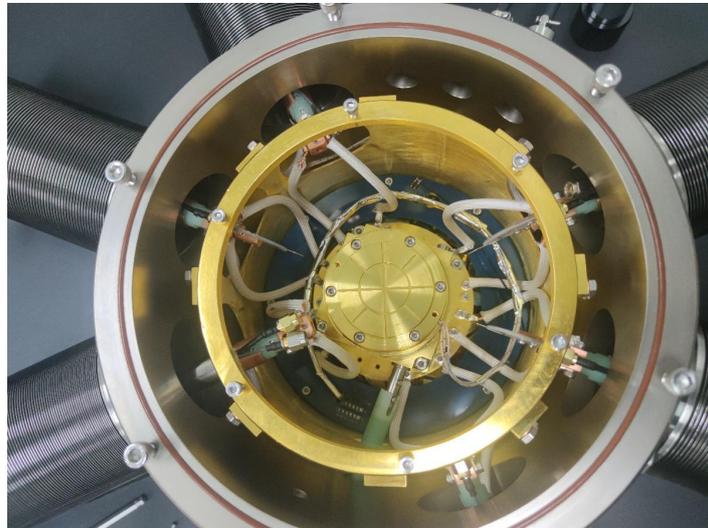
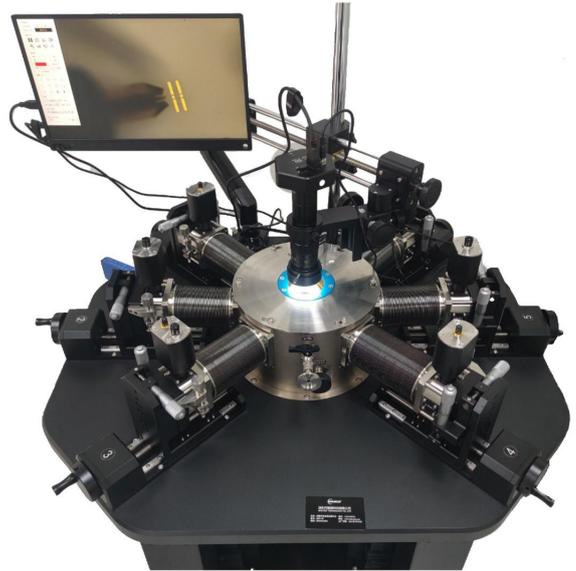
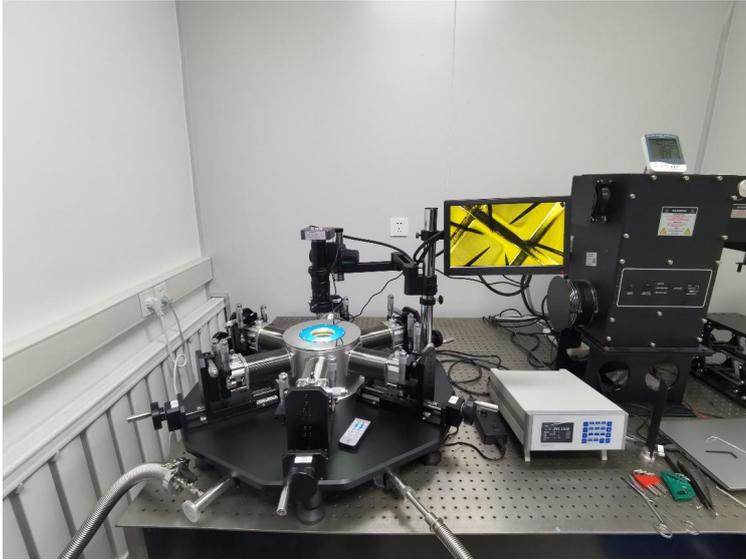


高低温真空探针台



产品特点

- 高真空度，真空度优于 5×10^{-4} Pa（约 4×10^{-6} Torr）
- 高精度温控系统，自动冷媒流量控制，4.5 K / 77.4 K - 675 K温度区间内精确控制样品台温度
- 防辐射屏设计，保证样品温度均匀
- 兼容高倍率金相显微镜
- 采用液氮或氦气压缩机制冷
- 可选配开尔文探针，更低的漏电精度
- 可升级光学、光电流测试、光学接入等
- 可定制加载磁场的真空探针台量或DC偏置

高低温真空探针台

应用方向

MCVP系列高低温真空探针台，能够为测试样品提供高真空和极端高温 / 低温的测试环境，非常适合各种半导体材料、芯片和电子元器件的无损测试，应用方向有：真空&极端温度条件下的芯片 / MEMS / NEMS测试；宽温区材料或器件的IV / CV特性测试；LD / LED / PD测试；光谱特性测试；霍尔效应测量；可变磁场环境中电磁输运特性测试；微波射频测试；瞬态光电流响应测试；拉曼-瞬态荧光寿命成像；电-光效应测试；超导测试试验等。

技术参数

型号		MCVP-2	MCVP-4	MCVP-2C
本体	样品台尺寸	2英寸	4英寸	2英寸
	样品固定方式	弹簧压片或真空导热硅脂		
	样品台类型	固定或旋转样品台		固定或旋转样品台
	观察窗尺寸	2英寸	4英寸	2英寸
	真空度	低温优于 4×10^{-6} Torr或 5×10^{-4} Pa		
	制冷方式	液氮		制冷机
	温度范围	约77.4 K -575 K, 可选77.4 K-675 K		8 K -350 K (固定载台) 25 K-350 K (旋转载台)
温控系统	温控精度	0.1 K / 0.01 K / 0.001 K		
	温度稳定性	± 0.3 K(473 K-675 K), ± 0.1 K(>-153 K), ± 0.2 K(<-153K)		
	低温控制方式	开循环自动液氮流量控制		闭循环自动控制
	加热电源	LVDC低压直流		
	加热功率	100 W / 200 W / 500W / 1000W		
	传感器	硅二极管 或 PT100		
	传感器数量	样品台、探针臂、防辐射屏各1个		
显微镜光学系统	类型	体视显微镜 / 单筒视频显微镜 / 金相显微镜		
	放大倍率	16X-200X (体视显微镜, 其他变倍比可选) / 20X -4000X (金相) / 视频显微镜 (主体变倍范围0.7X-4.5X或0.8X-5.0X等可选)		
	移动行程	双臂万向支架, 可水平方向任意位置无死角前后移动, 360°旋转, Z轴行程50.8 mm (适合体视或单筒视频显微镜) / X-Y微调移动2英寸×2英寸或4英寸×4英寸 (适合金相显微镜)		
	光源	外置LED光源 / 同轴光源		
CCD相机	200 W / 500 W / 1200 W像素可选			
探针臂	X-Y-Z移动行程	50 mm-50 mm-25 mm或100 mm-100 mm-25 mm		
	探针调节方式	外置探针臂, 手动调节, 真空波纹管结构		
	移动精度	5 μ m / 2 μ m		
探针夹具	固定探针方式	刀片陶瓷探针		
	线缆	同轴 / 三轴 / 射频同轴		
	漏电精度	10 pA / 100 fA / 30 fA		
	连接器类型	BNC / 三同轴TRB / SMA / 3.5 mm / 2.92 mm / 2.4 mm / 1.85 mm / 香蕉头 / 鳄鱼夹 / 接线端子 / 光纤接口		
探针	直流探针规格	针尖直径: 0.2 μ m / 1 μ m / 2 μ m / 5 μ m / 10 μ m / 20 μ m / 50 μ m		
	射频探针频率范围	DC~67 GHz		
真空系统	机械泵 / 分子泵真空机组			
外形尺寸 (长×宽×高) (mm)		约900×900×600		约1000×1000×600

高低温真空探针台

技术参数

型号	MCVP-2	MCVP-4	MCVP-2C
重量	约180 kg	约190 kg	约350 kg
电力需求	AC 220 V, 50 ~ 60 HZ		
可选附件	超高温升级选件	超高真空选件	镀金卡盘
	离子泵	移动样品台	高压测试选件
	光电流扫描成像系统	气敏测试选件	射频测试配件
	拉曼-瞬态荧光寿命成像系统		其他定制